(19)日本国特許广(JP) (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-29742

(P2001-29742A)(43)公開日 平成13年2月6日(2001.2.6)

(51) Int. Cl. ⁷	識別記 号	FI			テーマコート・	(参考)
B01D 53/68		B01D 53/34	134	С	4D002	
53/34	ZAB	B01J 20/06		Α	4G066	
B01J 20/06		B01D 53/34	ZAB			

審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全4頁)

(21)出願番号	特願平11-203451	(71)出願人	000005887 三井化学株式会社		
(22) 出願日	平成11年7月16日(1999.7.16)	(72)発明者	東京都千代田区霞が関三丁目2番5号原田 功山口県下関市彦島迫町七丁目1番1号 三井化学株式会社内		

最終頁に続く

(54)【発明の名称】金属ハロゲン排ガスの処理剤とその処理方法

(57)【要約】

【課題】

効率よく安全に金属ハロゲン排ガスを

処理する。

【解決手段】 固体金属酸化物を主成分とする金属ハ ロゲン排ガスの処理剤、及びそれを用い金属ハロゲンガ スを含む排ガスを該固体金属酸化物に通過し、処理す る。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 固体金属酸化物を主成分とする金属ハ ロゲン排ガスの処理剤。

1

【請求項2】 固体金属酸化物の元素が、Mg、C a、Ti、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Znから選 ばれる請求項1記載の処理剤。

【請求項3】 金属ハロゲン排ガスが、金属フッ素ガ ス、及び/または金属塩素ガスを含む排ガスである請求 項1記載の処理剤。

【請求項4】 固体金属酸化物の主成分が少なくとも 10 10重量%以上含有する請求項1記載の処理剤。

【請求項5】 固体金属酸化物の主成分が50重量% 以上含有する請求項1記載の処理剤。

【請求項6】 固体金属酸化物の比表面積が 0. 1 m ²/g以上である粒子であって、これを造粒又は/およ び打錠、押出しによって成型する請求項1記載の処理 剤。

【請求項7】 固体金属酸化物を主成分とし、金属ハ ロゲンガスを含む排ガスを該固体金属酸化物に通過し、 処理することを特徴とする金属ハロゲン排ガスの処理方 20 体金属酸化物に通過し、処理することを特徴とする金属 法。

【請求項8】 固体金属酸化物を金属ハロゲン排ガス が通過する際の温度が20~400℃である請求項7記 載の処理方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は金属ハロゲン排ガス の処理剤およびその処理方法に関する。さらに詳しく は、有機シラン系ガスの排ガスを固体金属酸化物の充填 層を通過させることにより、接触処理する乾式のガス処 30 理剤およびその処理方法に関する。

[0002]

【従来の技術】半導体製造用ガスの内、金属フッ素排ガ スと呼ばれるもので、特に四フッ化珪素、四塩化珪素、 四フッ化ゲルマニウム、四塩化ゲルマニウム、六フッ化 タングステン、等の金属フッ素排ガスは、ドーピングガ スとして特意な性能を発揮することで注目されている。 【0003】しかしながら、これらの殆どが毒性ガスと して取り扱われ、特に吸収により呼吸器を激しく刺激す るなど毒性が強く、若し高濃度で外部に放出されるなら 40 においても十分にその排ガス処理機能を果し得るものも ば、人体および自然環境への悪影響ははかり知れないも のがある。よって、製造工程および半導体工業における 排ガス中の金属フッ素ガス濃度の低減は、良好な作業環 境の保持並びに自然環境の破壊の防止に勤めることは、 取り扱う者の当然の責務である。

【0004】したがって、これらの金属フッ素排ガスは その他の有毒な排ガス同様、大気放出する前に無害化す る必要があり、従来から湿式による処理方法が提案され ている。湿式による処理としては、水洗浄スクラバーを 用い、水に接触させる処理方法が一般的に行われてい る。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、これら の金属ハロゲンガスは水によって分解され、HF及びH C1、金属酸化物等が生成し、これらの二次処理が必要 となってくる。またシラン、ジシラン等にドープされて 使用されるため、燃焼式の排ガス処理装置に、金属ハロ ゲンガスとモノシラン、ジシラン等の混じった排ガスを 処理すると、燃焼処理装置の機器を損傷するという問題 も指摘されており、実用上不都合な点が多い。

[0006]

【課題を解決するための手段】そこで、本発明者らは効 率よく安全に金属ハロゲン排ガスを処理することができ る処理剤およびその方法を得るため鋭意検討した結果、 固体金属酸化物を使用することにより、その目的を達成 することを見いだし、本発明を完成するに至った。

【0007】即ち、本発明は固体金属酸化物を主成分と する金属ハロゲン排ガスの処理剤、または固体金属酸化 物を主成分とし、金属ハロゲンガスを含む排ガスを該固 ハロゲン排ガスの処理方法に関する。

[発明の詳細な説明]

【0008】以下、本発明を更に詳細に説明する。本発 明で使用する固体金属酸化物は、殆どの金属元素の酸化 物が使用できる。中でも、MgO、CaO、TiO₂、 MnO₂, Fe₂O₃, CoO, NiO, CuO, ZnO 等は毒性が低く取り扱いが容易であり、比較的安価であ るので好ましい。それらは単体、あるいは二種以上の混 合物として用いることができる。

【0009】本発明は、前記の固体金属酸化物の主成分 が10重量%以上好ましくは50重量%以上含有する充 填層に金属ハロゲン排ガスを含有する排ガスを通気処理 する。用いる固体金属酸化物の比表面積は0.1㎡/ g以上とすることが、金属ハロゲンガスとの気固接触能 を向上させる上で望ましい。

【0010】また、固体金属酸化物の排ガス処理能力を 高めるために充填層の加熱を行いながら排ガスを送入す ることが効果的である。しかしながら、該加熱は固体金 属酸化物の種類によっては加熱を全く必要とせず、室温 あり、また処理すべき金属ハロゲン排ガスの濃度や目的 とする処理率によっては必ずしも必要不可欠なものでは ない。したがって、本発明では固体金属酸化物の温度は 20~400℃、好ましくは20~250℃が好適であ る。400℃を超えると使用する処理剤の劣化、またエ ネルギーのロスといったことから好ましくない。

【0011】現在半導体工場では、製造工程で残存する 金属ハロゲンガスを多量のN₂ガスによって希釈した 後、処理工程に移されることから、排ガスの総量は相当 50 なものとなる。

【0012】充填層には粉末のまま充填しても良いが圧 掲が大きくなり、ガスの流れが悪くなることから固体金 属酸化物は造粒または打錠成型、押出し成型したものが 望ましい。この際、造粒に必要なバインダーを用いるこ と、又その種類については特定するものではなく、本発 明に於いては何ら差し支えない。ここで用いるバインダ ーとしては、メチルセルロース、メチルエチルセルロー ス、ポリビニルアルコール等の有機バインダーや、水ガ ラス、ベントナイト等の無機バインダー等が使用でき

【0013】充填カラムには、高温で使用可能な汎用の 材質で鉄、銅、ステンレス、ニッケルといった金属製、 あるいは、ガラス、アルミナといった酸化物系で、一般 的に円筒状のものを使用する。また、充填カラムのサイ ズについては処理量や処理能力に応じたものを使用す る。

【0014】本発明を実施するための充填層は、1系列 でも十分であるが再生や交換等の操作上の観点からこれ を複数並列方式とし、それぞれを処理層、再生層とし相 体金属酸化物の表面で気固接触させることで、処理効果 を持たせることができるのである。

[0015]

【実施例】以下、実施例により更に詳細に説明する。な お、%、ppmは容量基準を表す。

実施例1

16. 5 φ m m × 2 0 0 m m の ステンレスカラムに比表 面積58 m²/gのCuO粒子をタブレットマシンで成 型し、充填量20ccを充填した後、WF。ガスをヘリ ウムガスで1%に希釈し、67cc/minで充填層に 30 通気し、充填層出口ガス中のWF。ガス濃度を分析し た。分析は光電離検出器(PID)を備えたガスクロマ

トグラフ (日立製 GC-3000) により行った。分 離カラムはPorapak-Pを使用。結果は表1に示 す通り、通気30分後のWF。ガス濃度の低減が確認さ

【0016】実施例2

れた。

実施例1と同様のカラム、及びガスクロ装置を用い、比 表面積 0. 7 m²/gのMgO粒子をタブレットマシン で成型し、充填量20ccを充填した。充填層の部分は ヒーターで200℃に加熱した後、WF。ガスをヘリウ 10 ムガスで1%に希釈し、67cc/minで充填層に通 気し、充填層出口ガス中のWF。ガス濃度を分析した。

分析は光電離検出器(PID)を備えたガスクロマトグ ラフ (日立製 GC-3000) により行った。分離カ ラムはPorapak-Pを使用。結果は表1に示す通 り、通気30分後のWF。ガス濃度の低減が確認され た。

【0017】実施例3~12

固体金属酸化物、形状、金属ハロゲンガス、充填層温度 及び通気前のガス濃度を表1のように変更した以外は実 互に切り換えて使用するのが望ましい。以上の如く、固 20 施例1と同様のカラム及びガスクロを用いて行った。結 果は表1に掲げる金属酸化物を使用することで、金属ハ ロゲンガスの濃度を低減することが確認された。

【0018】実施例13

モノシランガス及びWF。ガスをそれぞれ1%濃度を含 んだヘリウムガスを実施例1と同様のカラムに、タブレ ットマシンで成型した比表面積58m²/gのCuOを 20 c c を充填した後、該カラムに通気した。その結 果、表1に示す通りモノシランガス及びWF。ガス共 に、ガスの濃度を低減することが確認された。

[0019]

【表 1】

•								
実施例 成分		6	固体金属酸化物		処理ガス	没度		
	成分	比表 面積 (m²/g)	型状	カラム 温度 (℃)	中のガスの分	通気前 (%)	通気後 (ppm)	
1	CuO	58	タブレット	20	WF.	1	54	
2	MgO	0.7	†	200	1	1	16	
3	CaO	3.5	†	100	GeF₄	1	22	
4	Fe ₂ O ₂	106	造粒	50	†	1	5	
5	CuO	58	押し出し	400	SiF₄	1	30	
6	CuO	74	†	250	1	5	76	
7	CuO	58	タブレット	200	SiHF ₂	1	3	
8	NiO	43	1	20	SF ₆	1	14	
9	ZuO	51	1	100	SiCl₄	1	25	
10	CuO	74	1	200	SiH₂Cl₂	1	27	
11	Fe₂O₃	106	†	350	1	5	35	
12	CuO	74	1	200	(CH ₄) _s SiC1	1	22	
13	CuO	58	1	40	WF₀∕SiH.	1/1	51/0.5	

[0020]

【発明の効果】以上、詳細に説明したように本発明は固体金属酸化物の充填層に金属ハロゲン排ガスを通過させ

ることにより、排ガスの処理を効率よく安全に行うこと が可能となった。さらに、従来の処理方法と比べ、装置 の小型化を図れる。

フロントページの続き

F ターム(参考) 4D002 AA17 AA18 AA22 AA26 AC10 BA12 BA15 CA07 DA05 DA06 DA11 DA21 DA22 DA23 DA24 DA47 DA70 GA01 GA02 GB02 GB03 GB08 GB12 HA03 4G066 AA15B AA16B AA17B AA18B AA23B AA26B AA27B BA26 CA31 CA32 DA02 FA26 FA27 FA37